

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成21年4月9日(2009.4.9)

【公開番号】特開2006-234817(P2006-234817A)

【公開日】平成18年9月7日(2006.9.7)

【年通号数】公開・登録公報2006-035

【出願番号】特願2006-46266(P2006-46266)

【国際特許分類】

G 01 N 21/27 (2006.01)

G 01 N 21/05 (2006.01)

G 01 N 37/00 (2006.01)

【F I】

G 01 N 21/27 C

G 01 N 21/05

G 01 N 37/00 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成21年2月19日(2009.2.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも一部に表面プラズモン生成薄膜を含む基板を備えるS P Rセンサチップであって、可視光に対して透過性ではないが、不可視波長範囲の少なくとも一部における所定の波長を有する放射が該S P Rセンサチップを通り抜けて前記表面プラズモン生成薄膜に達することができる材料から少なくとも部分的には形成される、S P Rセンサチップ。

【請求項2】

前記基板は少なくとも1つのチャネルを備え、前記表面プラズモン生成薄膜は前記チャネル内に、又は該チャネルに隣接して配置される、請求項1に記載のS P Rセンサチップ。

【請求項3】

前記表面プラズモン生成薄膜に隣接した少なくとも1つのチャネルにおいて、クロマトグラフ分離媒体をさらに備える、請求項2に記載のS P Rセンサチップ。

【請求項4】

前記表面プラズモン生成薄膜に結合される親和性媒体をさらに備える、請求項1、2又は3に記載のS P Rセンサチップ。

【請求項5】

請求項1～4のいずれか1項に記載のS P Rセンサチップと、

前記所定の波長の不可視放射を生成し、前記P Rセンサチップに向かって該不可視放射を誘導するように構成された光検出器と

を備える、S P Rシステム。

【請求項6】

前記光検出器は、前記不可視放射が前記表面プラズモン生成薄膜から反射された後に、前記不可視放射を検出するように構成された検出器をさらに備える、請求項5に記載のS P Rシステム。

【請求項7】

請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 項に記載の S P R センサチップを提供するステップと、  
対象となる溶液を前記チャネルに通すステップと、

前記表面プラズモン生成薄膜に向けて、不可視放射を前記 S P R センサチップの前記基  
板に通すステップとを含む、方法。